

令和5年度 応用コース:手引き・基礎コース受講済みの方を対象とした電顕のステップアップコース

実施場所:伊都 超顕微解析研究センター(CE21)

Advanced course:Step-up course of electron microscopy for those who have already taken the guide and basic course 【The following courses are usually held in Japanese.】

(時間:受講時間は各コースによって異なります。 The length of time takes depends on each course.)

開催月 Month	コース Training course	使用予定装置 Using the device	実施日 Date	研修内容(予定) Training content	申込締切日 定員になり次第 受付終了します
5月 May	走査透過電顕法(STEM) ^{※1} Scanning-Transmission Electron microscopy	収差補正電顕(ARM-200F) Cs-corrected EM	講義: 5/23(水)10:00-12:00 実習: 5/24(木) or 25(木) 10:00-16:00	収差補正器の付いた電子顕微鏡の原理・操作方法【ロンチグラム調整・STEM像取(HAADF・BF)】 The principal and operation of Cs-corrected EM【Adjust Ronchgram・STEM image(HAADF・BF)】	受付終了
6月 Jun.	分析TEM法 ^{※2} Analysis Electron Microscopy	収差補正電顕(ARM-200F) Cs-corrected EM	講義: 6/13(火)10:00-12:00 実習: 6/14(水) or 15(木) 10:00-17:00	透過型電顕による各分析(XEDS・EELS)の方法 How to Analysis by TEM (XEDS・EELS)	受付終了
	FIBによる試料作製法 ^{※3} Sample preparation using FIB	FIB-SEM (Quanta,MI4000L)	講義: 6/19(月)10:00-17:00 (デモ含む) 実習: 6/20(火)-23(金) 10:00-17:00 のうち1日	FIB-SEMによるTEM試料作製方法 TEM sample preparation method using FIB-SEM	受付終了
7月 Jul.	分析SEM法 Analysis Scanning Electron Microscopy	SEM (Ultra55)	講義: 7/20(木)10:00-17:00 実習: 7/21(金) or 24(月) 10:00-15:30	SEMによる各分析(XEDS・EBSD)の方法 How to Analysis by SEM (XEDS・EBSD)	受付終了
8月 Aug.	電子回折とその解析 Electron Diffraction and the Analysis	JEM-2100HC	講義: 8/1(火)10:00-15:00 実習: 8/2(水) 10:00-15:30	電子回折の取得と解析 Aquisition and Analysis of Electron Diffraction	受付終了
	高分解能電顕法 ^{※2} High Resolution Electron microscopy	収差補正電顕(ARM-200F) Cs-corrected EM	講義: 8/29(火)10:00-12:00 実習: 8/30(水) or 8/31(木)10:00-16:00	TEM(収差補正電顕)での高分解能像の取得方法 How to take High Resolution Image by TEM (Cs-corrected TEM)	受付終了
9月 Sep.	超高压電子顕微鏡 High Voltage TEM	超高压電顕 HVEM	講義: 9/26(火) 実習: 9/27(水) 10:00-15:30	超高压電子顕微鏡(初級編) 超高压電顕の基本操作及び試料の観察・分析 HVEM (Elementary Course) How it works (Observation and Analysis)	受付終了
10月 Oct.	走査透過電顕法(STEM) ^{※1} Scanning-Transmission Electron microscopy (STEM)	収差補正電顕(ARM-200F) Cs-corrected EM	講義: 10/11(水)10:00-12:00 実習: 10/12(木) or 13(金) 10:00-16:00	収差補正器の付いた電子顕微鏡の原理・操作方法【ロンチグラム調整・STEM像取得(HAADF・BF)】 The principal and operation of Cs-corrected EM 【Adjust Ronchgram・STEM image (HAADF・BF)】	受付終了

※1. 5月と10月のSTEMは同じ内容です。

"Scanning-Transmission Electron microscopy (STEM)" in May and October are the same in content.

※2. 「分析TEM法」、「高分解能法」受講希望の方は、先に「STEM」を受講してください。

If you want to take "Analysis Electron Microscopy" and "High Resolution Electron microscopy", please take "STEM" in advance.

※3. 「FIBによる試料作製法」受講希望の方は、先に基礎コース(SEM)を受講してください。

If you want to take "Sample preparation using FIB", please take the Basic Course (SEM) in advance.